

試料作製室の利用案内

場所:千現地区 精密計測実験棟 103 室

■利用可能時間と利用対象者

- 利用可能時間は平日 9:00~16:30 です。
- ライセンス保持者のみ入室可能で、ライセンスを取得した装置のみ利用可能です。
- ライセンスは年度ごとに更新手続きが必要です。
- 入退室の際はスタッフルーム(精密計測実験棟 101 室)でカードキーを借用/返却ください。

■予約ルールと利用料金

- 要予約の装置と予約不要の装置があります。
 - 要予約の装置
 - ・精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS
 - ・イオンサイザー Ion Slicer EM-9100IS
 - ・ディンプルグラインダー Dimple Grinder
 - ・自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw
 - ・精密研磨装 Multiprep System
 - 操作講習は「技術補助」、ライセンス取得後は「機器利用」の利用料金がかかります。
 - ライセンス取得後は、予約システムにて、1 時間単位で予約ください。
例:10:30-12:00 は NG /10:00-12:00 は OK
 - 予約システムの入力時間は、利用料金にそのまま反映されます。一日使用する場合は休憩時間の前後で予約を分けられます。
 - 1 日の予約枠の数に制限はありません。
 - 予約日の前日までは予約システムでキャンセルや変更が可能です。
 - 急な予約のキャンセルや変更をご希望の際は、電子顕微鏡ユニット事務局 (tem@nims.go.jp)および担当スタッフにご連絡ください。
-
- 予約不要の装置
 - その他の装置(コーター類等)は、ライセンス保持者であれば、予約なしで利用可能です。ただし、他のユーザーと時間が被る可能性があることを予めご了承ください。
 - 操作講習は「技術補助」の利用料金がかかりますが、ライセンス取得後の「機器利用」は非課金です。

TEM 試料作製装置群の装置リスト

要予約



■自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw

- ・低速回転/軽荷重
- ・4 インチダイヤモンド切断砥石
- ・ブレード回転数: 0~300 rpm



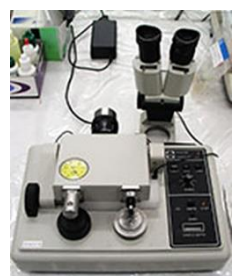
■精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS

- ・加速電圧: 0.1~6 kV
- ・研磨角: $\pm 10^\circ$ (0.1°ステップ)
- ・使用ガス: アルゴン
- ・液体窒素冷却ステージ



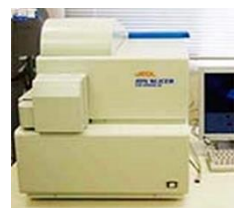
■精密研磨装置 Multiprep System

- ・試料傾斜角度: 0~10°
- ・研磨盤回転速度: 5~350 rpm
- ・試料研磨荷重: 0~600 g
- ・精密マイクロメーター付き



■ディンプルグラインダー Dimple Grinder

- ・試料研磨ホイール径: 15 mm
- ・試料研磨荷重: 0~40 g
- ・研磨ホイール回転速度: 0~600 rpm
- ・初期試料厚さ: 200 μm 以下
- ・自動停止機構付き



■イオンサイザー Ion Slicer EM-9100IS

- ・加速電圧: 1~8 kV
- ・研磨角: $\pm 6^\circ$ (0.1°ステップ)
- ・使用ガス: アルゴン

予約不要



- ・カーボンコーター JEC-560
- ・白金コーターJFC-1600
- ・金コーターJFC-1500
- ・オスミウムコーター HPC-1SW
- ・ターボ式真空蒸着機 SVC-700※
- ※蒸着源は持参ください。
- ・その他(ホットプレート等)